

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

I część zamówienia - przedmiotem zamówienia jest wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4.

L.p.	Indeks materiałowy	Ilość
1	Segment pokrywy nr części: 100215823	1
2	Dysk grafitowy 5,1" nr części: 100064661	1
3	Planeta 4" AIX1 nr części: 100239770	1
4	Sufit (pokrywa górna) PyroC nr części: 100204369	1
5	Kolektor górny nr części: 100244268	1
6	Kolektor środkowy nr części: 100244273	1
7	Kolektor dolny nr części: 100244247	1

II część zamówienia - przedmiotem zamówienia jest czyszczenie części reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje czyszczenie następujących elementów:

L.p.	Indeks materiałowy	Ilość
1	Rurociąg, składający się z 5 części	1
2	Zawór	1
3	Filtr główny CT2000	1
4	Pułapka P	1

III część zamówienia - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna C1 CS200SA S/N.

Gaz procesowy	Nazwa chemiczna	Wymagane maksymalne stężenie
DEZ (DEZn)	Dietylocynk	< 2 mg/m ³ (jako Zn)
TMA (TMAI)	Trimetyloglin	< 2 mg/m ³ (jako Al)
TMG (TMGa)	Trimetylogal	< 3 mg/m ³ (jako Ga ₂ O ₃)
TMI (TMIn)	Trimetyloind	< 0,1 mg/m ³ (jako In)
CBr ₄	Tetrabromometan	< 1 ppm (jako HBr)
AsH ₃	Arsenowodór	< 0,05 ppm
PH ₃	Fosforowodór	< 0,1 ppm
SiH ₄	Silan	< 5 ppm



Rzeczpospolita
Polska

VIGO
PHOTONICS

NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

H ₂ / N ₂	Wodór / Azot (gazy nośne)	
---------------------------------	------------------------------	--